

Probe card company PMT orders EVG 'maskless' lithography equipment - January 25, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. The LITHOSCALE system will be installed at PMT's headquarters in Asan-si, Chungcheongnam-Do, South Korea, where it will be used in the production of next-generation MEMS-based probe cards for wafer-level testing of advanced NAND, DRAM and HBM devices. According to Young-Sik Yun, general manager of EV Group Korea, "Wafer-level testing with probe cards is an essential process for improving device production yields and reducing overall test cost per die. LITHOSCALE offers a unique combination of high resolution, high flexibility to handle many different product designs, and low cost of ownership, making it an ideal solution for manufacturing fine-pitch wafer probe cards.



프로브카드 기업 피엠티, EVG '마스크리스' 리소그래피 장비 발주

마스크 사용 없이 미세 피치 프로브카드 제작 가능해

반도체 - 디스플레이 | 입력 2024/01/24 09:56

장영준 기자 | 기자 배워서 구독 | 기사원문 보기

[이벤트] HPE Cray 제품 중 관심 제품의 전적 요청 시 크리스피 크림 도넛 기프티콘을 드립니다

EV그룹(이하 EVG)은 반도체 웨이퍼 프로브카드 전문기업이자 프로빙 기술사인 피엠티와 리소스케일(LITHOSCALE) 마스크리스 노광 시스템에 대한 공급 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

MEMS(미세전자기계시스템)는 미세 공정의 복잡성으로 인해 노광비를 조사해 회로를 새기는 공정의 난이도가 높은 분야다. 때문에 노광공정에 쓰이는 핵심 부품인 마스크 제조비용이 불리는 부담이 있었다.



프로브카드 업체인 피엠티 대표이사, 양명식 EVG 한국지사장(왼쪽)-EVG

반면 EVG의 리소스케일은 실제 마스크 대신 마스크 에이러를 실시간으로 전송해 노광을 진행하는 기술이다. 높은 초점 심도와 고분해능의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브카드의 핵심 기술인 고밀도 레아웃 레이아웃(RDL)과 비아(Via) 연결이 가능하게 해준다.

이번 계약으로 EVG의 리소스케일 시스템은 피엠티 본사에 설치되어 첨단 낸드, DRAM, 고대역폭메모리(HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트를 차세대 MEMS 기반 프로브카드 제조에 사용될 예정이다.

프로브카드 업체인 피엠티 대표이사는 "미세 피치 프로브카드는 반복적인 리소그래피 패러미터 공정을 통해 제작되어 제조 비용 증가 최소화가 필요하다"며 "기존의 마스크 얼라인너(Mask Aligner)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 리소스케일로 대체함으로써 제조 비용 절감 및 공정 개발이 용이해, 프로세스 성능 향상 등을 기대할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

양명식 EVG 한국지사 차사장은 "피엠티가 차세대 프로브카드를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 중계되어 매우 기쁘다"며 "리소스케일은 높은 분해능, 다양한 패턴을 정밀하게 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소류 비용을 특성화한 특장적인 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브카드 제조용으로 매우 이상적"이라고 밝혔다.